

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0081 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	浜松ホトニクス株式会社 品質本部 品質統括部
法人の名称	浜松ホトニクス株式会社 法人番号 2080401004193
問い合わせ窓口	品質本部 品質統括部 TEL : 053-584-0268 FAX : 053-584-0276



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認 定 識 別： JCSS 0081 Calibration

校正機関の名称： 浜松ホトニクス株式会社

品質本部 品質統括部

校正機関の所在地： 静岡県浜松市浜名区平口 5000 番地

法 人 の 名 称： 浜松ホトニクス株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2027 年 5 月 22 日

登録（認定）に係る区分：光

法律に基づく初回登録年月日：2004 年 5 月 11 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2004 年 5 月 11 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：光度標準電球等[2023 年 5 月 23 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
光度標準電球等	光度標準光源 (タングステンランプ)	10 cd 以上 400 cd 以下	3.1 %
	分光放射照度標準光源 (タングステンランプ)	250 nm 以上 260 nm 未満	7.6 %
		260 nm 以上 270 nm 未満	7.2 %
		270 nm 以上 360 nm 未満	6.1 %
		360 nm 以上 460 nm 未満	5.0 %
		460 nm 以上 600 nm 以下	4.0 %
		600 nm 超 830 nm 以下	3.9 %
		830 nm 超 2300 nm 以下	4.8 %
		2300 nm 超 2500 nm 以下	7.0 %
	分光放射照度標準光源 (重水素ランプ)	200 nm 以上 210 nm 未満	14 %
		210 nm 以上 230 nm 未満	13 %
		230 nm 以上 360 nm 以下	6.6 %
		360 nm 超 400 nm 以下	7.0 %
	分光放射照度標準光源 (キセノンランプ)	200 nm 以上 210 nm 未満	17 %
		210 nm 以上 230 nm 未満	14 %
		230 nm 以上 310 nm 未満	8.2 %
		310 nm 以上 360 nm 未満	7.3 %
		360 nm 以上 480 nm 未満	5.7 %
		480 nm 以上 700 nm 以下	4.4 %
		700 nm 超 750 nm 以下	4.8 %
		750 nm 超 780 nm 未満	8.2 %
		780 nm 以上 800 nm 以下	4.3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
光度標準電球等	分布温度標準電球 (タングステンランプ)	2000 K 以上 2900 K 以下	20 K
	分光応答度標準検出器 (シリコンフォトダイオード)	200 nm	5.3 %
		205 nm	4.9 %
		210 nm	4.6 %
		215 nm	4.2 %
		220 nm	3.8 %
		225 nm	3.4 %
		230 nm	3.2 %
		235 nm	3.0 %
		240 nm	2.4 %
		245 nm 以上 380 nm 未満	2.2 %
		380 nm 以上 430 nm 未満	1.6 %
		430 nm 以上 510 nm 未満	1.2 %
		510 nm 以上 600 nm 未満	0.90 %
		600 nm 以上 845 nm 以下	0.70 %
		845 nm 超 940 nm 以下	0.90 %
		940 nm 超 985 nm 以下	1.4 %
		985 nm 超 1000 nm 以下	1.6 %
		1000 nm 超 1030 nm 以下	2.2 %
		1030 nm 超 1050 nm 以下	2.7 %
		1050 nm 超 1075 nm 以下	3.3 %
		1075 nm 超 1090 nm 以下	3.7 %
		1090 nm 超 1105 nm 以下	4.0 %
		1105 nm 超 1120 nm 以下	4.4 %
		1120 nm 超 1130 nm 以下	4.7 %
		1130 nm 超 1135 nm 以下	4.9 %
		1135 nm 超 1145 nm 以下	5.2 %
		1145 nm 超 1150 nm 以下	5.6 %
	分光応答度標準検出器 (InGaAsフォトダイオード)	800 nm 以上 900 nm 以下	1.9 %
		900 nm 超 950 nm 未満	2.4 %
		950 nm 以上 1200 nm 以下	2.1 %
		1200 nm 超 1350 nm 以下	2.2 %
		1350 nm 超 1410 nm 未満	2.7 %
		1410 nm 以上 1610 nm 以下	2.2 %
		1610 nm 超 1625 nm 以下	2.5 %
		1625 nm 超 1650 nm 以下	3.2 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：電気（高周波）及び電磁界

法律に基づく初回登録年月日：2008 年 7 月 23 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2008 年 7 月 23 日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：レーザパワー測定器等〔2023 年 5 月 23 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
レーザパワー 測定器等	レーザビーム用 光パワー測定器	405 nm 帯	1 mW 以上 5 mW 未満	2.6 %
			5 mW 以上 10 mW 以下	2.6 %
		488 nm 帯	4 mW 以上 10 mW 以下	2.2 %
		532 nm 帯	1 mW 以上 5 mW 未満	1.8 %
			5 mW 以上 10 mW 以下	1.8 %
		633 nm 帯	1 mW 以上 5 mW 未満	1.5 %
			5 mW 以上 10 mW 以下	1.6 %
		780 nm 帯	1 mW 以上 5 mW 未満	1.8 %
			5 mW 以上 10 mW 以下	1.8 %
		850 nm 帯	1 mW 以上 5 mW 未満	1.7 %
			5 mW 以上 10 mW 以下	1.8 %
		1064 nm 帯	1 mW	2.1 %
		1310 nm 帯	1 mW	2.8 %
		1550 nm 帯	1 mW	2.0 %
	光ファイバ用 光パワー測定器	1310 nm 帯	1 mW	1.7 %
		1550 nm 帯	1 mW	1.3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。